

敬致

台灣真空學會誠摯邀請 您於 9/20(三)上午 10:00 前往台北南港展覽館參加「2017 智慧顯示與觸控展」開幕典禮及本學會「真空與鍍膜技術主題館」參觀交流(4 樓)；會議資訊如下：

★『智慧顯示與觸控展—真空與鍍膜技術主題館』

時間：106 年 9 月 20~22 日 (三日全天) 10:00 ~ 17:30

地點：台北世貿中心南港展覽館 1 館 4 樓 M620 主走道邊



★『開幕典禮』2017 年智慧顯示與觸控展—系列活動

時間：106 年 9 月 20 日(三) 上午 10:00

地點：台北世貿中心南港展覽 1 館 4 樓

【敬請攜帶名片入場】

WELCOME

台灣真空學會理事長 **洪瑞華** 敬邀

中華民國 106 年 9 月 5 日

「真空與鍍膜技術主題館」結合台灣自製真空系統元件設備廠家機構集中於 9m×24m 大展區聯展，本(2017)年度 12 個參展單位如下：

★亮傑科技有限公司、伊譜瑪科技股份有限公司、冰研應用股份有限公司、新萊應材科技有限公司、立盟系統科技股份有限公司、明志科技大學薄膜科技與應用中心、應用奈米科技股份有限公司、歐特威科技股份有限公司、漢鐘真空科技股份有限公司、勝欣精密工業股份有限公司、國家同步輻射研究中心、台灣真空學會。

★ 9/20~9/22 真空與鍍膜技術主題館 現場免費 技術講座

場次/時間	主題/主講人
第一場 9/20 (三) 11:00 ~ 12:00	PECVD Processes Using a Microwave Plasma - Dr. Thomas Schutte
第二場 9/20 (三) 13:00 ~ 14:00	Advanced MF and HIPIMS Pulsed Power Supply Launch for Industrial Mass Production - Dieter Schorn , Robert Jann
第三場 9/20 (三) 15:00 ~ 16:00	先進物理鍍膜技術與設備開發-高功率脈衝磁控濺鍍 系統與保護性鍍膜之發展 - 李志偉教授
第四場 9/21 (四) 11:00 ~ 12:00	Beyond PEM-Advanced Spectroscopic Process Control for Industrial Plasma Application - Dr. Thomas Schutte
第五場 9/21 (四) 13:00~14:00	High Value RF Power Delivery Solutions in Plasma Processing - 許榮先生
第六場 9/21 (四) 15:00 ~ 16:00	同步加速器光源的產業應用新契機 - 許博淵博士
第七場 9/22 (五) 11:00 ~ 12:00	質譜式氦氣測漏儀真空抽氣能力對測漏背景值及靈敏 度及速度的影響 - 陳智明先生
第八場 9/22 (五) 13:00 ~ 14:00	A Total Solution to Rotary Cathode - 林朝陽博士

~ 歡迎親臨會場參加，講座現場備有研磨咖啡及點心 ~